

...SU ... 1137513

4(51) G 11 B 5/34

гооударственный номитет ссор по делам изовретений и отнрытий

THE BRITISH LIBRARY

26 APR 1985

SCIENCE REFERENCE LIBRARY

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3585490/24-10

(22) 25.04.83

(46) 30.01.85. Ban. # 4

(72) А. В. Ермолович и В. В. Петров

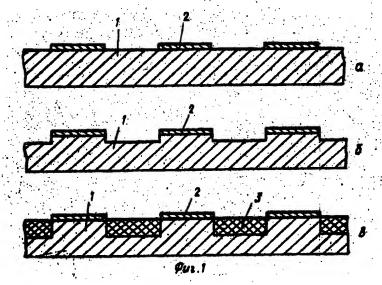
(71) Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР

(53) 681.84.089.8(088.8)

(56) 1. Патент Японии № 51-42485,

кл. G 1.1 B 5/84, 1976. 2. Koshino N., Ogawa S. Optical method of the head Positioning in magnetic disk systems. -"IEEE Transactions on magnetics, 1980, V.16, P 5, р.631-633 (прототип).

(54) (57) СПОСОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСкой сервоповерхности дискового магНИТНОГО НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ, включаюший нанесение маски на поверхность основы, заполнение немаскированных участков поверхности диффузно-отражающим материалом и удаление маски с поверхности основы, о т л и ч в ю щ ийся тем, что, с целью повышения технологичности при одновременном повышении качества сервоповержности, предварительно производят ... электрожимическое полирование поверхности основы, перед заполнением производят травление тех же участкой, а заполнение осуществляют анодированиен в том же электролите, что при травлении.



Изобретение относится к области некопления информации, а именно к способам изготовления магнитных носителей информации.

Известен способ изготовления сврвоповержности, при котором растр попучают путам маскирования магнитного регистрирующего материала в мастах расположения элементов растра с. высоким отражениям и формирования элементов растра с нияким отражением путем окрашивания магнитного регистрирующего материела в немаскирован-HUX MECTAX [1] .

Недостатками известного способа являются малая разность козффициантов отражения и малая механическая стойкость элементов растра.

Наиболев близжим ж предлагаемому по технической сущности и достигаемо- 20 му результату является способ изготовления оптической сервоповержиости, при котором вся повержность основы. диска анодируется; затем анодиал пленка маскируется фоторезистом в местах расположения элементов растра с высоким отражением, после чего формируются эпементы растра с низким отражением путем окращивания анодной пленки в немаскированных местах, а слов магнитного регистрирующего материала наносится поверх растра, выполненного на основе, поеле удаления маски из фоторезиста [2].

Надостаткамы этого способа являотся малые коэффициенты отражения элементов растра и малая их разность, а также повышенные шумы носителя, вызываемые модупяцией толщины магнитиого регистрирующего материала из-за порис- 40 той структуры поверхности анодной пленки.

Цель изобретения - повышение технологичности при одновременном повышении качества сервоповерхности.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу изготовления опотокожони итооничакоповора Комранит магнитного носителя информации, включающему нанесение маски на повержность 50 основы, заполнение немаскированных участков повержности диффузно-отражаюшим материалом и удаление маски с поверхности основы, предварительно производят электрохимическое полирование55 повержности основы, перед заполнением производят травление тех же участков, а заполнение осуществляют анодирова-

что и при нием в том же электролите, травлении...

На фиг. 1 (а,б,в) показаны сечения сновы на различных этапах формирования растра (на фиг. 1а - основа 1 с нанесенной маской из фоторевиста 2; на фиг. 16 - то же, после травления; на фиг. 1в - то же, после заполнения анодной оксидной пленкой 3); на фиг. 2фрагмент носителя с оптической сврвоповерхностью.

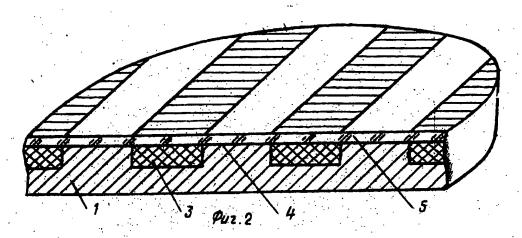
Носитель информации на фиг. 2 содержит основу 1, участок 3 растра с низким коэффициантом отражения (анодную пленку), участок 4 с высоким коэффициентом отражения и магнитный

регистрирующий слой 5.

Оптическую сервоповержность дискового магнитного носителя информации изготовляют следующим образом.

После чистовой механической обработки проводят электрохимическое попирование основы і носителя. Затем наносят маску из фоторезиста 2, по конфигурации соответствующую участкам растра с высоким коэффициентом отражения, производят экспонирования и проявление фоторезиста. В комбинированном электролите на основе кромовой или щавалавой кислот или их солей при плотности тока 8-10 А/дм² про хиннаворих эмнеления немаскированных участков повержности основы до образования впадин. Затем в ток же электропите при плотности тока 0,8-1,0 А/дм производят внодирование впадин - заполнение нарашиванием анодной оксидной пленки 3 до исчезновения рельфера повержности, т.в. формирование участков растра с низким коэффициентом отражения: Под маской из фоторезиста 2 остаются учестии 4 с высоким коэффициентом отражения, который обеспечивается электрохимическим полированием. После удаления фоторевистивной маски 2 производят нанесение магинтного регистрирующего слоя 5.

Изобретение позволяет эначительно повысить технологичность процесса, повысить качество сервоповержности при уменьшении шумов носителя, поскольку повышается контраст кежду участками с высоким и низким коэффициентами отражения, а также уменьшается пористость структуры повержности анодной пленки.



Составитель С. Ильчук
Редактор М. Петрова Техред С.Легеза Корректор В. Бутяга
Заказ 10333/39 Тираж 583 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4